

# 高分解能薄膜構造解析用X線回折装置

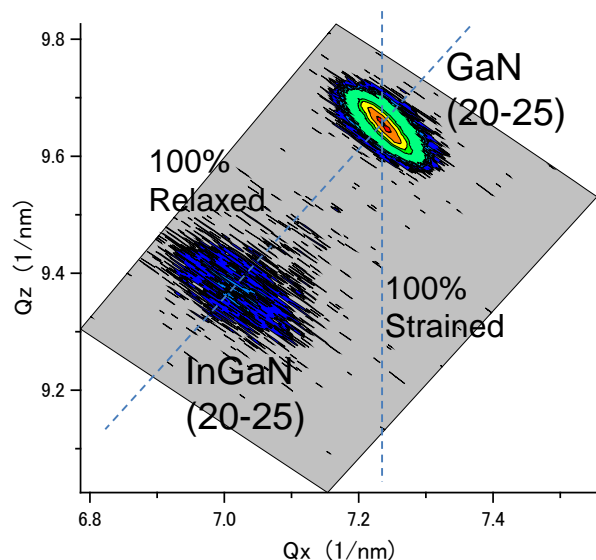


Rigaku: ATX-E

**用途:** 結晶性薄膜試料の構造  
格子定数、組成、結晶性の精密解析

## 特徴

- 1) 入射光学系: 2結晶 Ge (220) チャンネルカットモノクロメータ使用
- 2) 試料ステージ: X, Y,  $\phi$ ,  $\chi$ , Z の5軸駆動
- 3) 制御・解析ソフト: 自動調整(光学系調整、試料位置調整、自動軸立て等)プログラム、自動測定(2 $\theta$ / $\omega$  スキャン、 $\omega$  スキャン、逆格子マッピング等)プログラム



GaN テンプレート上にエピ  
タキシャル成長した InGaN  
の逆格子マッピング